(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-79114

(P2000-79114A)

(43)公開日 平成12年3月21日(2000.3.21)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

A 6 1 B 6/03

320 350

A 6 1 B 6/03 320Y

350H

審査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平11-232228

(22)出願日

平成11年8月19日(1999.8.19)

(31)優先権主張番号 09/140110

(32)優先日

平成10年8月25日(1998.8.25)

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 390041542

ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ

GENERAL ELECTRIC CO

MPANY

アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネ

クタデイ、リバーロード、1番

(72)発明者 ニール・バリー・プロムバーグ

アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ミル

ウォーキー、ノース・ハイマウント・プー

ルヴァード、1833番

(74)代理人 100076303

弁理士 生沼 徳二

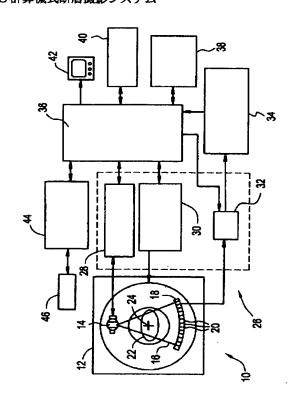
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 検出器のセル間ばらつきを監視する方法及び計算機式断層撮影システム

(57)【要約】

【課題】 計算機式断層撮影(CT)システム等のイメ ージング・システムにおいて、検出器の老朽化によるセ ル間ばらつきを補正する。

【解決手段】 チャネルの相対ゲインを測定するアルゴ リズムを定期的に実行する。ゲインは、例えば空気走査 からの信号を記録して共通の基準に正規化することによ り測定する。正規化過程の一部は、X線ビームの非一様 性、例えばヒール効果を扱うことを含む。zにおけるX 線束のプロファイルは、x方向において緩やかに変化し ており、xにおける低域フィルタ処理によって得られる ものと仮定する。次いで、正規化後の値を予め決定され ている規格値と比較し、いずれかの特定のセルが規格値 パラメータの範囲内になければ、このようなセルが存在 するモジュールを交換する。また、傾向分析を行って、 検出器が規格値に対して不適格となる時期を予測して、 不良が生ずる前に検出器の交換を行えるようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 X線源がイメージング平面に沿ってX線ビームを形成し目つ検出器が z 軸方向に延在している複数の検出器セルを含んでいる計算機式断層撮影システムで、該検出器におけるセル間ばらつきを監視する方法であって、

走査を実行する工程と、

前記検出器セルからデータを取得する工程と、

該セル・データを規格値と比較する工程とを備えている 当該方法。

【請求項2】 前記走査を実行する前記工程は、空気走 査を実行する工程を含んでいる請求項1に記載の方法。

【請求項3】 前記セル・データを規格値と比較する前に、前記セル・データを正規化する工程を更に含んでいる請求項1に記載の方法。

【請求項4】 前記セル・データを正規化する前記工程は、前記X線ビームの非一様性を補償する工程を含んでいる請求項3に記載の方法。

【請求項5】 前記検出器はマルチスライス型検出器である請求項1に記載の方法。

【請求項6】 傾向分析を行って、いつ検出器が前記規格値に対して不適格になるかを予測する工程を更に含んでいる請求項1に記載の方法。

【請求項7】 X線源及び少なくとも1つのマルチスライス型検出器モジュールを含み、各々の検出器モジュールが z 軸方向に延在している複数の検出器セルを含んでいるイメージング・システムであって、

走査を実行し、前記検出器セルからデータを取得し、該セル・データを規格値と比較するように構成されているイメージング・システム。

【請求項8】 前記走査は空気走査である請求項7に記 歳のシステム。

【請求項9】 当該システムは前記セル・データを正規 化するように更に構成されている請求項7に記載のシステム

【請求項10】 当該システムは前記X線ビームの非一様性を補償するように更に構成されている請求項9に記載のシステム。

【請求項11】 前記検出器はマルチスライス型検出器である請求項7に記載のシステム。

【請求項12】 当該システムは、傾向分析を行って、いつ検出器が前記規格値に対して不適格になるかを予測するように更に構成されている請求項7に記載のシステム。

【請求項13】 当該システムは、前記空気走査の実行 を開始する遠隔サポート・センタを更に含んでいる請求 項7に記載のシステム。

【請求項14】 イメージング平面に沿ってX線ビーム られる散乱したX線ビームをコリメートするポスト・ペを形成するX線源と、z軸方向に延在している複数の検 イシェント(post-patient)コリメータを含んでいる。ポ出器セルを含んでいる検出器とを含んでいるマルチスラ 50 スト・ペイシェント・コリメータに隣接してシンチレー

イス型計算機式断層撮影システムであって、

走査を実行し、前記検出器セルからデータを取得し、該 セル・データを規格値と比較することによって、セル間 ゲインばらつきを監視するように構成されているマルチ スライス型計算機式断層撮影システム。

【請求項15】 前記走査は空気走査である請求項14 に記載のシステム。

【請求項16】 当該システムは、前記セル・データを 正規化するように更に構成されている請求項14に記載 10 のシステム。

【請求項17】 当該システムは、前記X線ビームの非一様性を補償するように更に構成されている請求項16に記載のシステム。

【請求項18】 当該システムは、傾向分析を行って、いつ検出器が前記規格値に対して不適格になるかを予測するように更に構成されている請求項14に記載のシステム。

【請求項19】 当該システムは、前記空気走査の実行を開始する遠隔サポート・センタを更に含んでいる請求20 項14に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一般的にはイメージングに関し、より具体的にはイメージング・システムにおいて検出器の性能を監視することに関する。

[0002]

【従来の技術】計算機式断層撮影(CT)イメージング・システム等の少なくともいくつかの公知の医川イメージング・システムにおいては、X線源がファン(扇形)30 形状のビームを投射し、このビームは、一般的に「イメージング(作像)平面」と呼ばれるデカルト座標系のXーY平面内に位置するようにコリメートされる。X線ビームは、患者などのイメージング対象となる被検体を通過する。ビームは、被検体によって減弱した後に、放射線検出器の配列(アレイ)に入射する。検出器アレイの所で受け取られる減弱したX線ビームの強度は、被検体によるX線ビームの減弱量に依存している。アレイ内の各々の検出器素子は、検出器の位置におけるビーム減弱の測定値である個別の電気信号を発生する。すべての検出器からの減弱測定値が別個に取得されて、透過プロファイルを形成する。

【0003】公知の第3世代CTシステムでは、X線源及び検出器アレイは、X線ビームが被検体と交差する角度が定常的に変化するように、イメージング平面内で被検体の周りをガントリと共に回転する。X線源は典型的には、焦点においてX線ビームを放出するX線管を含んでいる。X線検出器は典型的には、検出器の所で受け取られる散乱したX線ビームをコリメートするポスト・ペイシェント(post-patient)コリメータを含んでいる。ポスト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチレースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチースト・ペイシェント・コリメータに際控してシンチースト・ペイシェント・コリスト・ペイシェント・コリスト・ペイシェント・コレスト・フィームが被検体と交流であります。

タが配置されており、シンチレータに隣接してフォトダ イオードが配置されている。

【0004】マルチスライス型CTシステムは、走査の 際に、増大した数のスライスのデータを取得するために 用いられている。公知のマルチスライス型システムは典 型的には、3D(3次元)検出器として広く知られてい る検出器を含んでいる。これらの3D検出器では、複数 の検出器素子が、行及び列を成して配列されている別個 のチャネルを形成している。検出器の各々の行は、それ ぞれ別個のスライスを形成する。例えば、ツー(2)ス 10 ライス検出器は2行の検出器素子を有しており、フォー (4) スライス検出器は4行の検出器素子を有してい る。マルチスライス走査の際には、多数の行の検出器セ ルにX線ビームが同時に入射するので、いくつかのスラ イスのデータが得られる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】検出器の複数のチャネ ルは典型的には、複数の行を形成するように一緒に連結 されている。z方向でのチャネル間のばらつきによっ て、画像アーティファクトが生じる可能性がある。検出 器が老朽化するにつれて、ゲイン(利得)のばらつきが 放射線損傷に起因して変化する。このようなチャネル間 ばらつきの補正は公知であるが、これらの補正の有効性 は、ばらつきの大きさに依存している。

[0006]

【課題を解決するための手段】これらの及び他の目的 は、イメージング・システムによって定期的に実行され て、セル間ばらつきを検出して最大許容チャネル間ばら つきを越えないように保証するアルゴリズムによって達 成することが出来る。より詳しく述べると、本発明の一 面によれば、チャネルの相対ゲインを測定するアルゴリ ズムが定期的に実行される。ゲインは、例えば、空気走 査からの信号を記録して、該信号を共通基準に対して正 規化することにより測定される。正規化過程の一部は、 X線ビームの非一様性、例えばヒール効果 (heel effec t)を扱うことを含んでいる。zにおけるX線束のプロ ファイルは、x方向において緩やかに変化しており、且 つxにおける低域フィルタ処理によって得られるものと 仮定する。次いで、正規化値(正規化された値)が、予 め決定されている規格値と比較される。いずれかの特定 のセルが規格値パラメータの範囲内になければ、このよ うなセルが存在しているモジュールを交換することがで

【0007】ゲインのばらつきを測定して、このばらつ きを規格値と比較することに加えて、傾向分析を行うこ ともできる。傾向分析アルゴリズムは、検出器が規格値 に対して不適格となる時期を予測して、不良が生ずる前 に検出器の交換を行えるようにする。

[0008]

施例による例示的なマルチスライス型CTシステムの説 明である。このシステムの実施例を以下に詳述するが、 本発明の多くの代替的な実施例が可能であることを理解 されたい。例えば、1つの特定の検出器が記載されてい るが、本発明を他の検出器と共に用いることができ、本 発明は何らかの1つの特定の形式のマルチスライス型検 出器による実施に限定されているわけではない。より詳 しく述べると、以下に記載される検出器は複数のモジュ ールを含んでおり、各々のモジュールは複数の検出器セ ルを含んでいる。以下に記載される特定的な検出器では なく、マルチスライス走査データを同時に取得するよう に、x 軸及び/又は z 軸に沿った多数の素子がいずれか の方向に全体としてまとめられているような多数のモジ ュールを有する検出器を用いることができる。一般的に は、本発明のシステムは、1つ又はそれ以上のスライス 分のデータを収集するようにマルチスライス・モードで 動作することが可能である。このシステムによってアキ シャル・スキャン(軸方向走査)及びヘリカル・スキャ ン(螺旋走査)を行うことができ、走査された被検体の 断面画像を処理し、再構成し、表示し、及び/又は保存 することができる。

【0009】図1及び図2について説明すると、計算機 式断層撮影(СТ)イメージング・システム10が、 「第3世代」のCTスキャナで典型的なガントリ12を 含んでいるものとして示されている。ガントリ12はX 線源14を備えており、X線源14は、ガントリ12の 対向する側に設けられている検出器アレイ18に向かっ てX線ビーム16を投射する。検出器アレイ18は複数 の検出器素子20によって形成されており、これらの検 出器素子20は全体で、患者22を通過した投射された X線を感知する。各々の検出器素子20は、入射するX 線ビームの強度を表す電気信号、従って患者22を通過 する間でのビームの減弱量を表す電気信号を発生する。 X線投影データを取得するための1回の走査の間に、ガ ントリ12及びガントリ12に装着されている構成部品 は回転中心24の周りを回転する。

【0010】ガントリ12の回転及びX線源14の動作 は、CTシステム10の制御機構26によって制御され る。制御機構26は、X線制御装置28及びガントリ・ モータ制御装置30を含んでいる。X線制御装置28は X線源14に対して電力信号及びタイミング信号を供給 し、ガントリ・モータ制御装置30はガントリ12の回 転速度及び位置を制御する。制御機構26内に設けられ ているデータ取得システム(DAS)32が、検出器素 子20からのアナログ・データをサンプリングして、こ のデータを後続の処理のためにディジタル信号へ変換す る。画像再構成装置34が、サンプリングされてディジ タル化されたX線データをDAS32から受け取って、 高速画像再構成を実行する。再構成された画像は、コン 【発明の実施の形態】以下に述べるのは、本発明の一実 50 ピュータ36への入力として印加され、コンピュータ3

50

6は大容量記憶装置38に画像を記憶させる。

【0011】 コンピュータ36はまた、ユーザ・インタ フェイス、即ちグラフィック・ユーザ・インタフェイス (GUI) を介して信号を受信し又は供給する。詳しく 述べると、コンピュータは、キーボードとマウス(図示 されていない)とを有するコンソール40を介して、操 作者からコマンド(命令)及び走査用パラメータを受け 取る。付設されている陰極線管表示装置42によって、 操作者は、再構成された画像、及びコンピュータ36か らのその他のデータを観測することができる。操作者が 供給したコマンド及びパラメータは、コンピュータ36 によって川いられて、DAS32、X線制御装置28及 びガントリ・モータ制御装置30に制御信号及び情報を 供給する。加えて、コンピュータ36はまたテーブル・ モータ制御装置44を動作させ、テーブル・モータ制御 装置44はモータ式テーブル46を制御して、患者22 をガントリ12内に配置する。具体的には、テーブル4 6は、患者22の各部をガントリ開口48を通して移動 させる。

【0012】図3及び図4に示すように、検出器アレイ 18は、複数の検出器モジュール58を含んでいる。各 々の検出器モジュール58は、検出器ハウジング60に 固定されている。各々のモジュール58は、多次元のシ ンチレータ・アレイ62及び高密度半導体アレイ(図で は見えない)を含んでいる。ポスト・ペイシェント・コ リメータ(図示されていない)が、シンチレータ・アレ イ62の上に隣接して配置されており、X線ビームがシ ンチレータ・アレイ62に入射する前にこれらのビーム をコリメートする。シンチレータ・アレイ62は、配列 を成して構成されている複数のシンチレーション素子を 含んでおり、また半導体アレイは、同一の配列を成して 構成されている複数のフォトダイオード(図では見えな い)を含んでいる。フォトダイオードは、基材64上に 堆積され即ち形成されており、シンチレータ・アレイ6 2は、基材64の上方に配置されて基材64に固定され ている。

【0013】検出器モジュール58はまたスイッチ装置66を含んでおり、スイッチ装置66はデコーダ68に電気的に結合されている。スイッチ装置66は、フォトダイオード・アレイと同様のサイズを有する多次元の半導体スイッチ・アレイである。一実施例では、スイッチ装置66は、電界効果トランジスタ(FET)のアレイ(図示されていない)を含んでおり、各々の電界効果トランジスタは、入力、出力及び制御線(図示されていない)を有している。スイッチ装置66は、フォトダイナード・アレイとDAS32との間に結合されている。具体的には、各々のスイッチ装置のFETの出力が、例えば可撓性の電気ケーブル70を用いてDAS32に電気的に接続さ

れている。

【0014】デコーダ68は、スイッチ装置66の動作 を制御して、スライスの所望の数及び各々のスライスに ついてのスライス分解能に従って、フォトダイオード・ アレイの出力をイネーブル(enable)にしたり、ディスエ ーブル(diable)にしたり、又は組み合わせたりする。デ コーダ68は、一実施例では、当業界で公知のデコーダ チップ又はFETコントローラである。デコーダ68 は、スイッチ装置66及びコンピュータ36に結合され ている複数の出力線及び制御線を含んでいる。具体的に は、デコーダの出力はスイッチ装置の制御線に電気的に 接続されていて、スイッチ装置66がスイッチ装置入力 からスイッチ装置出力へ適正なデータを伝送し得るよう にする。デコーダの制御線はスイッチ装置の制御線に電 気的に接続されていて、どのデコーダ出力をイネーブル にするかを決定する。デコーダ68を川いて、フォトダ イオード・アレイの特定の出力がCTシステムのDAS 32に電気的に接続されるように、スイッチ装置66内 の特定のFETをイネーブルにしたり、ディスエーブル にしたり、又は糺み合わせたりする。16スライス・モ ードとして定義される一実施例では、デコーダ68は、 フォトダイオード・アレイ52のすべての行がDAS3 2に電気的に接続されて、結果的に16個の別個のスラ イスのデータが同時にDAS32に送信されるようにス イッチ装置66をイネーブルにする。言うまでもなく、 他の多くのスライスの組み合わせが可能である。

6

【0015】特定の一実施例では、検出器18は57個 の検出器モジュール58を含む。半導体アレイ及びシン チレータ・アレイ62はそれぞれ、16×16のアレイ ・サイズを有する。その結果、検出器18は16の行と 912の列(16×57モジュール)とを有し、これに より、ガントリ12の各回転によって16個のスライス のデータを同時に収集することが可能になる。言うまで もなく、本発明は、何らかの特定のアレイ・サイズに限 定されているわけではなく、アレイは操作者の特定の必 要性に応じてより大きくてもよいし又はより小さくても よいものと考えられる。また、検出器18は多くの異な るスライス厚及び数のモード、例えば、1スライス・モ ード、2スライス・モード及び4スライス・モードで動 作し得る。例えば、FETを4スライス・モードとして 構成することができ、そうすると、フォトダイオード・ アレイの1行又はそれ以上の行から4つのスライスにつ いてのデータが収集される。デコーダの制御線によって 画定されるFETの特定の構成に応じて、フォトダイオ ード・アレイの出力の様々な組み合わせをイネーブルに したり、ディスエーブルにしたり、又は組み合わせたり することができ、スライス厚が例えば1.25mm、 2. 5 mm、3. 7 5 mm又は 5 mmになるようにする ことができる。更なる実例には、1.25mm乃至20 mmのスライス厚を持つ1つのスライスを含むシングル

7

・スライス・モード、及び1.25mm乃至10mmのスライス厚を持つ2つのスライスを含む2スライス・モードがある。ここに記載した以外の他のモードも可能である。

【0016】図5は、「4(又はカド(quad))スライス」システムの単純化された概略図である。即ち、このシステムでは、検出器セルの4つの行102、104、106及び108を川いて投影データを得る。検出器セル110、112、114及び116が、行102、104、106及び108を形成している。図5に示す各々の検出器セル110、112、114及び116は実際には、一定数のセル(例えば、4個)で構成することができ、これらのセルは一緒に連結されて、DAS32に供給される1つの出力を形成する。

【0017】一実施例では、コリメータ92が、偏心カム120A及び120Bを含んでいる。カム120A及び120Bを含んでいる。カム120A及び120Bは、ファン・ビーム平面94の対向する両側に配置されており、カム120Aとカム120Bとの間の間隔に関して、また、ファン・ビーム平面94に対するカム120A及び120Bの位置に関して独立に調節することができる。カム120A及び120Bは単一のカム・ドライブにより位置決めしてもよいし、又は代替的に各々のカムを別個のカム・ドライブ、例えばモータにより位置決めしてもよい。カム120A及び120Bは、X線吸収性材料、例えばタングステンで作製される。

【0018】偏心的な形状の結果として、それぞれのカム120A及び120Bの回転によって、X線ビーム16のz軸プロファイルが変化する。より詳しく述べると、カム120A及び120Bの位置を変化させると、X線ビームの本影(umbra)の位置及び幅が変化する。具体的には、偏心的な形状のカム120A及び120Bが連動して段階移動(stepping)する結果として、X線ビームの本影の全体幅が変化する。カム120Aのみの位置を変化させ、即ち段階移動させると、検出器アレイ18の一方のエッジに対する本影の幅及び位置が変化す *

 $\{X_{1.1}\}$ $l = 1, \dots, 16;$

が得られる。ゲイン、即ち列における最大値に対する正 規化を含めた公称(nominal)ゲイン・プロファイルの 40 定義のために、「x」平均値が定義される。ここで、naveは、公称ゲインの定義の「x」移動平均について※

*る。カム120Bのみの位置を変化させると、検出器アレイ18の他方のエッジ、即ち第2のエッジに対する本影の幅及び位置が変化し、患者22が受け取るX線の照射量が低減されるようになる。

【0019】動作の際、X線源14は固定され、即ち固定位置に配置され、またそれぞれのカム120A及び120Bは、X線ビーム16がコリメータ92を通過して検出器アレイ18に向かって放射されるように、名II上の位置に配置される。次いで、それぞれのカム120A及び120Bの一連の段階、即ち一連の位置について、データが検出器アレイ18から収集される。コリメータ92のアパーチャを変化させることにより、具体的にはカム120A及び120Bを調節することにより、セル110、112、114及び116から適正な信号強度を形成するように最適なX線ビームが検出器18上へ放射される。

【0020】前に述べたように、検出器セル110、1 12、114及び116が老朽化するにつれて、チャネ ル間のゲインばらつきが変化する。最大許容チャネル間 ばらつきを越えないことを保証するために、本発則の一 20 面によれば、各チャネルの相対ゲインを測定するアルゴ リズムが定期的に実行される。これらのゲインは、空気 走査からの信号を記録して、該信号を共通の基準に対し て正規化することにより測定される。正規化過程の一部 は、X線ビームの非一様性、例えばヒール効果を扱うこ とを含んでいる。zにおけるX線束のプロファイルは、 x 方向において緩やかに変化しており、x における低域 フィルタ処理によって得られるものと仮定する。次い で、正規化値が、予め決定されている規格値と比較され 30 る。いずれかの特定のセルが規格値パラメータの範囲内 になければ、このようなセルが存在しているモジュール を交換することができる。

【0021】1つの特定の実施例では、収集されたデータに対して z 勾配補正(z-slope correction)が実行される。詳しく述べると、空気走査及びビュー平均化によって得られる個々のセルの測定値から開始して、オフセット減算及び基準チャネル正規化を行った後に、

 $i=1, \dots, N \mathcal{F} + \lambda \mathcal{V}$

※用いられるチャネルの数(奇数)である。

40 [0022]

【数1】

【数2】

$$bp_l(i) = \frac{1}{nave} \sum_{k=i-(nave-1)/2}^{k=i+(nave-1)/2} \left[\frac{X_{l,k}}{\max_{1 \le l \le 16} X_{i,l}} \right]$$

【0023】次いで、zにおける最大値に対する正規化によって、以下の式が得られる。

[0024]

【0025】すると、公称ゲインは、以下の式によって 定義することができる。

[0026]

【数3】

$$G_{i,l} = G_l(i) = \frac{\left(\frac{X_{l,i}}{\max\limits_{1 \le l \le 16} X_{l,i}}\right)}{BP_l(i)}$$

【0027】これらの公称ゲインはz勾配補正アルゴリ ズム用の入力となる。公称ゲインは、それら自体によっ て勾配関連アーティファクトを画像内に生じるわけでは ないが補正過程において扱われなければ不安定性をもた らす可能性のある緩やかな「x」のばらつきをモデル化 する際に要求される。3つの実例を挙げると、(1)シ ンチレータのエッジにおけるツイン公称ゲイン・プロフ ァイル、(2)ヒール効果によるX線ビームのzプロフ 20 アイル、及び(3)予期される低照射量モードでの動作 のためにビームの半影を用いることにより誘起される部 分照射条件 (partial illumination condition) であ る。Gの要素は、1に近い数の範囲内になる。この範囲 の正確な境界は、経験的に決定される。

【0028】ゲインのばらつきを測定して、このばらつ きを規格値と比較することに加えて、傾向分析を行うこ ともできる。傾向分析アルゴリズムは、検出器が規格値 に対して不適格となる時期を予測して、不良が生ずる前 に検出器の交換を行えるようにする。傾向分析アルゴリ ズムは、時間に関して一定な使用のパターンを仮定して おり、また川いられている特定の検出器について、検出 器素子の老朽化が線形的に生ずるものと仮定する。線形 モデルに対する最小自乗法によるフィット(当てはめ) が、時間の関数として、ゲイン行列の各々の要素に対し て行われる。一般的には、傾向分析アルゴリズムの性質 は、検出器材料の老朽化特性に依存する。

【0029】データは、例えば自動サポート・センタに より、遠隔方式で、マルチスライス型スキャナから検索 し分析することができる。例えば、電話回線を介してP 40 94 ファン・ビーム平面 P P モデム接続を用いてデータを検索してもよい。本発 明の様々な実施例に関する以上の記述から、発明の目的 が達せられたことは明らかである。本発明を詳細に記述 すると共に図解したが、これらは説明及び例示のみを意

図したものであり、限定のためのものであると解釈して はならないことを明瞭に理解されたい。従って、本発明 の要旨は、特許請求の範囲によって限定されるものとす る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 C T イメージング・システムの見取り図であ

【図2】図1に示すシステムの概略ブロック図である。

【図3】CTシステムの検出器アレイの斜視図である。

【図4】検出器モジュールの斜視図である。 10

【図5】図1に示すCTイメージング・システムの概略 配置図である。

【符号の説明】

10 CTシステム

12 ガントリ

14 X線源

16 X線ビーム

18 検出器アレイ

20 検出器素子

2.4 回転中心

26 制御機構

28 X線制御装置

30 ガントリ・モータ制御装置

32 データ取得システム

34 画像再構成装置

36 コンピュータ

38 大容量記憶装置

40 コンソール

42 陰極線管表示装置

44 テーブル・モータ制御装置

46 モータ式テーブル

58 検出器モジュール

60 検出器ハウジング

62 シンチレータ・アレイ

6 4 基材

66 スイッチ装置

68 デコーダ

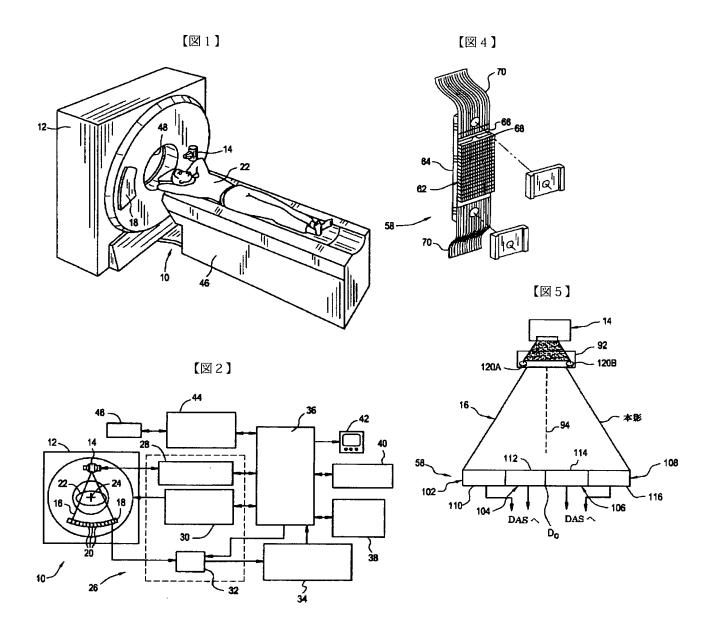
70 電気ケーブル

92 コリメータ

102、104、106、108 検出器セルの行

110、112、114、116 検出器セル

120A、120B 偏心カム



[X3]

フロントページの続き

- (72)発明者 フィ・デイヴィッド・ヒー アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ワウ ケシャ、リンカーンシャー・コート、2806 番
- (72)発明者 マリー・スー・クルピンス アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ニュ ー・バーリン、サウス・バース・ドライ ブ、6225番